EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

02281782

PUBLICATION DATE

19-11-90

APPLICATION DATE

24-04-89

APPLICATION NUMBER

01105205

APPLICANT: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD:

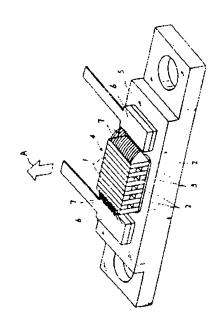
INVENTOR: NAGAI HIDEO;

INT.CL.

: H01S 3/18 H01S 3/25

TITLE

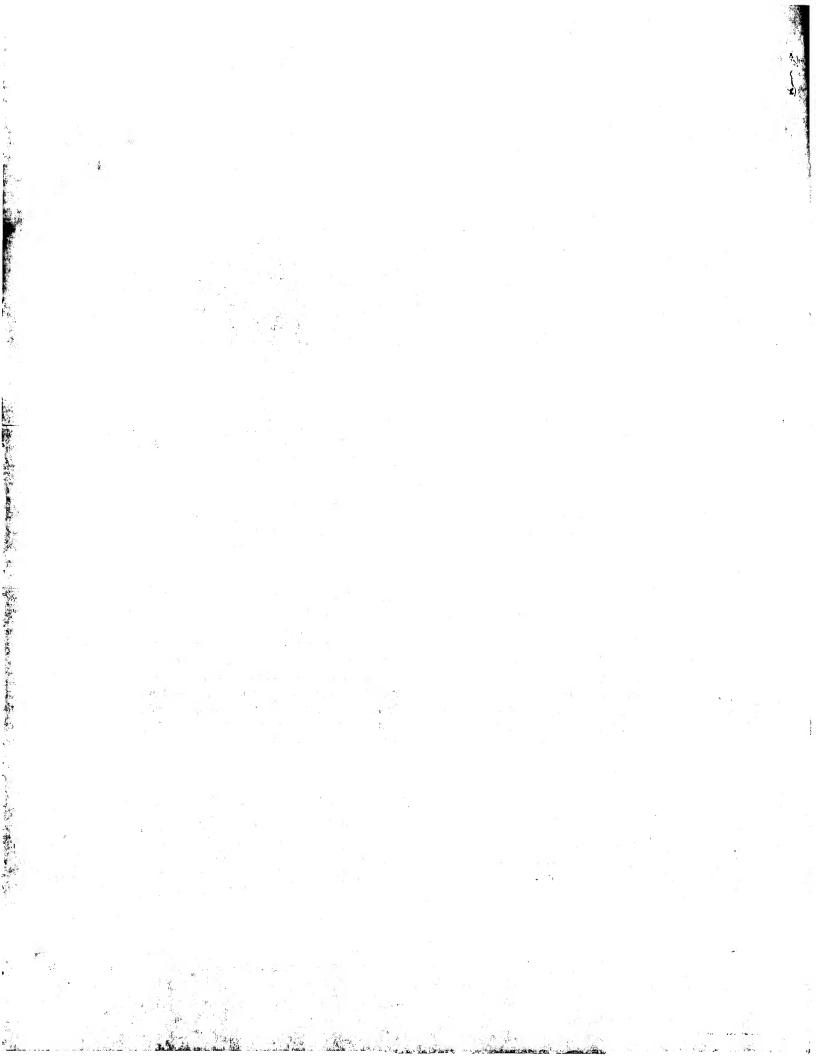
SEMICONDUCTOR LASER ARRAY



ABSTRACT: PURPOSE: To obtain continuous oscillation by placing a two-dimensional semiconductor array, wherein plural pieces of one-dimensional semiconductor arrays are placed in layer shape between insulating plates excellent in heat conductivity, on a heat radiating member through the insulating plates.

> CONSTITUTION: Plural pieces of one-dimensional semiconductor arrays 1 are placed in layer shape between insulating plates 2 excellent in heat conductivity so as to constitute a two-dimensional semiconductor laser array 4, and this two-dimensional semiconductor laser array 4 is placed on a heat radiating member 5 through the insulating plates 2. For the material of the insulating plates 2, BN is used which is almost the same as GaAs being laser crystals in point of cost and in heat expansion coefficient. Hereby, the heat generated from the one-dimensional semiconductor laser array 1 is transmitted to the heat radiating member 5 through the insulating plate 2 excellent in heat conductivity, and heat radiation is performed enough, and the temperature rise of the semiconductor laser array device is suppressed, and also continuous oscillation becomes possible.

COPYRIGHT: (C) JPO



⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平2-281782 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)11月19日

H 01 S

7377-5F

7630-5F H 01 S 3/23

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称

半導体レーザアレイ装置

②特 頤 平1-105205

博

頤 平1(1989)4月24日 ②出

⑫発 明 者 @発 明

19代 理 人

粂 内藤 浩

弁理士 森本

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

@発 明 者

樹 男 秀

袭 弘

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

永 井 勿出 顔 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

1. 発明の名称

半導体レーザアレイ装置

2. 特許請求の範囲

1、複数個のレーザ光出射点が一次元に並べら れてなる一次元半導体レーザアレイを、熱伝導 性の良い絶縁板の間に複数個層状に配置して二 次元半導体レーザアレイを構成し、かつこのニ 次元半導体レーザアレイを、その絶縁板を介し て放熱部材上に収置した半導体レーザアレイ装

3、発明の絆根な説明

産業上の利用分野

本発明は、固体レーザ結晶の励起や、加工用に 用いられる高出力の半導体レーザアレイ装置に関 するものである。

従来の技術

半導体レーザはスペクトル幅が狭く高効率であ り、Nd:YAG結晶などの固体レーザ結晶の吸 収スペクトルに波長を合わせることにより効率良

く励起できるため、従来のランプに代る固体レー ザ励起光顔として近年注目を集めるようになって きた。半導体レーザを固体レーザの励起光療とし て用いる場合、励起光源の光密度が高いことが必 要となる。半導体レーザの発光領域の大きさは10 μm×2μm程度であるため、多数の発光部であ るレーザ光出射点を一次元(直原的)あるいはニ 次元(平面的)に並べた半導体レーザアレイとす ることにより、権めて高い光密度を得ることが可 能である。半導体レーザをYAGレーザの助起光 源に用いた場合の結合効率は、半導体レーザの電 気-光変換効率が30%、YAGレーザの入力励起 光-レーザ出力光変換効率が30%であるので、10 %近い値が得られ、これはランプ励起の場合の10 岱以上となる。また、余分な波長の光の吸収によ る結晶の発熱がなく、YAGレーザの冷却も軽減 される。従来、半導体レーザで高出力を得る場合、 多数のレーザ光出射点を高密度でもって二次元に すなわち平面上に配置する必要がある。ところで、 半導体レーザは結晶の劈開面を共振器に用いるた

特開平2-281782(2)

め、一枚の基板上にモノリシックにレーザ光出射 点を並べることは容易ではない。そこで一次元に レーザ光出射点を並べたパー状の半導体レーザア レイを用い、これをさらに二次元に配置すること が考えられる。

発明が解決しようとする課題

の遅いパルス動作しかさせることができない。

そこで、本見明は上記課題を解削し得る半導体 レーザアレイ装置を提供することを目的とする。 課題を解決するための手段

上記録類を解決するため、本発明の半導体レーザアレイを選は、複数個のレーザ光出射点が一次元に並べられてなる一次元半導体レーザアレイを、然伝導性の良い地様板の間に複数個層状に配置して二次元半導体レーザアレイを構成し、かつこの二次元半導体レーザアレイを、その絶縁板を介して放無部材上に戦慢したものである。

作用

上記の構成において、一次元半導体レーザアレイから発生した無は無伝導性の良い絶縁仮を介して放熱部材に伝導されて、放熱が十分に行われる。 したがって半導体レーザアレイ装置の温度上昇が 抑制されるとともに連続発掘も可能となる。

実施例

以下、本発明の一実施例を図面に基づき説明する。

第1回に半導体レーザアレイ装置の外観斜視図、 第2回に回装置の提部斜視図および部品分解斜視 図を示す。

第1回および第2回において、1はたとえば10 個のレーザ光出射点(発光点ともいう)が100 μmの間隔で一次元に並べて構成されたパー状の ー次元半導体レーザアレイで、長さ 1.2mm 、厚さ 100μm、共振器長さ 250μmとされている。こ の一次元半導体レーザアレイ1は、5個並履され るとともに、これらの間および両外側に熱伝導性 の良い材料で構成された輪線板2が介装されて層 状にされるとともに、一次元半導体レーザアレイ 1とは反対側の各絶縁板2の間に、絶縁板2と同 じ材質で構成された絶様スペーサ 3 が介装されて、 二次元半導体レーザアレイ4が構成されている。 そして、さらにこの個状の二次元半導体レーザア レイ4は、その絶験スペーサ3側の端面がヒート シンク(放熟部材)5の表面に接触するように、 ヒートシンク5上に秘密されている。なお、上記 絶縁板2の材質としては、熱伝導率の点ではダイ

ヤモンドが一番優れているが、コストの点と熱影 盗係数がレーザ結晶であるGaASとほとんど同 じであるという点でBNの方が優れている。BN の熱伝導率はダイヤモンドの3分の1であるが銅 より2倍以上と優れているので本実施例において はBNが使用されている。また、絶縁板2の厚さ は 100μmとされており、第2図に示すように、 上下部の表面にはCr-Pt-Auのメタライズ パターンaがほどこされている。なお、金パター ン上にはAu-Sn、Pb-Snなどの半田材が **蒸着され、一次元半導体レーザアレイ1と融着で** きるようにされている。上記半田材は熟伝導性が 悪いため、その膜厚は3μmと薄くされている。 また、上記二次元半導体レーザアレイ4は、金メ ッキされた肩型のヒートシンク5上に、 P b -Snなどの半田材を用いて融着されており、もち ろん絶縁スペーサ3を介装したのは、ヒートシン ク5との熱伝導面積を増加させるためである。上 記絶様スペーサ3の表面にも金のメタライズパタ ーンaがほどこされている。なお、ヒートシンク

特閒平2-281782(3)

5 側の電極端子6と二次元半導はレーザアシイ4の電極端子としての両側部の絶縁板2とは金ワイヤフで接続され、また10A近い大電流を流すため、金ワイヤフの水数は50木程度にされている。

上記明成においては、各一次元半導体レーザアレイ1で発生した熱は、絶縁板2および絶様スペーサ3を介してヒートシンク5側に伝導されて、放熱が十分に行われる。なお、第1図および第2図中、矢印Aは二次元半導体レーザアレイ4から出針されるレーザ光である。

ここで、上記の半導体レーザアレイ装置における電流ー出力特性を第3回に示す。なお、一次元半導体レーザアレイ1が5本直列に接続されているので、印加電圧は約10Vとなる。第3回から分かるように、6Aの電流で20W以上の光出力が得られており、電気からレーザ光への変換効率は33%と非常に良い結果が得られている。 発光部であるレーザ光出射点の面積は約1㎡であるので光医度は2KW/cdとなり、YAGレーザの励起光板としては過足すべき特性が得られている.

置における電流~光出力特性図である。

1 … - 次元半導体レーザアレイ、2 … 絶縁板、3 … 絶縁スペーサ、4 … 二次元半導体レーザアレイ、5 … ヒートシンク。

代理人 森 本 養 弘

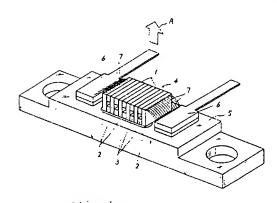
なお、略様板28まび絶様スペーサ3の材質として、質(Cu)、ダイヤモンド(C)の他に、たとえば窓化ホウ素(BN)、炭化ケイ素(SiC)、ベリリア(BeO)、窒化アルミニウム(A2N)などが使用される。 発明の効果

以上のように、本発明の構成によれば、、一次元 半導体レーザアレイから発生する熱を熱伝導性の 良い絶縁板を介して放熱部材に伝導させて十分な 放熱を行うことができ、したかってで選択罪死を 行うことができるない、この半導体レーザの 行うことができるに、してがかかり、 では、スラブ型固体レーザの連続動作用かる 光級に通しており、さらに多数のブロックを乗る することにより高効率のKW吸通続発掘スラブ型 固体レーザの実現を可能とするものである。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の半導体レーザアレイ装置の外 収料視回、第2回は同半導体レーザアレイ装置の 要部の斜視図、第3回は同半導体レーザアレイ装

第 / 图



ノ… - 次元半等体レーサアレイ

2… 艳橡板

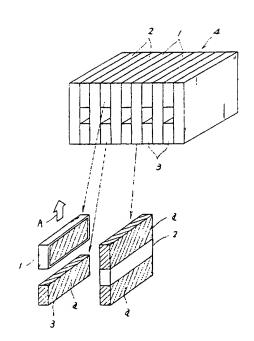
3…艳禄スペーサ

4…二次元半等体レーサアレイ

5 . ヒートシンク

持周平2-281782(4)

第 2 図



第3図

